

(11)Publication number:

2002-093610

(43)Date of publication of application: 29.03.2002

(51)Int.CI.

H01F 1/06 H01F 1/053 H01F 41/02

(21)Application number: 2000-285679

(22)Date of filing:

20.09.2000

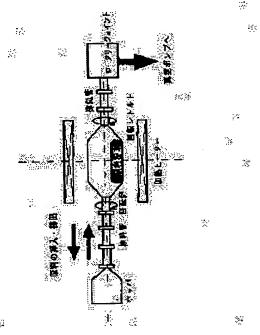
(71)Applicant: AICHI STEEL WORKS LTD

(72)Inventor: MOTOKURA YOSHINOBU

HAMADA NORIHIKO **MISHIMA CHISATO**

(54) METHOD OF MANUFACTURING ANISOTROPIC MAGNET POWDER, MATERIAL POWDER OF ANISOTROPIC MAGNET POWDER, AND BONDED MAGNET

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of manufacturing anisotropic magnet powder, which is capable of obtaining a bonded magnet that has a superior permanent demagnetization factor. SOLUTION: RFeB material (R: rear earth element) is subjected to a low- temperature hydrogenation process, a high-temperature hydrogenation process, and a first exhaust process, through which RFeBHX powder as hydrogenated matter is manufactured, diffusion powder formed of hydrogenated dysprosium is mixed into RFeBHX powder (material powder of anisotropic magnet powder) as the starting material; and the mixture is subjected to a diffusion thermal process and a dehydrogenation process, by which anisotropic magnet powder having high coercive force and superior in anisotropic properties can be obtained. A bonded magnet, formed of the above anisotropic magnet powder, has a superior permanent demagnetization factor.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.05,2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3452254

[Date of registration]

18.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-93610 (P2002-93610A)

(43)公開日 平成14年3月29日(2002.3.29)

(51) Int.Cl. ⁷		設別記号	FΙ		ž	j-7]-/¹(参考)
H01F	1/06		H01F	41/02	G	5 E O 4 O
	1/053			1/06	Α	5 E 0 6 2
	41/02			1/04	н	

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 15 頁)

(21)出願番号	特願2000-285679(P2000-285679)	(71)出願人	000116655 愛知製鋼株式会社
(22)出願日	平成12年9月20日(2000.9.20)		愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地
		(72)発明者	
			愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地 愛知製 鋼株式会社内
		(72)発明者	
		(, =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地 愛知製 鋼株式会社内
		(74)代理人	
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	弁理士 大川 宏
			具放百件结子

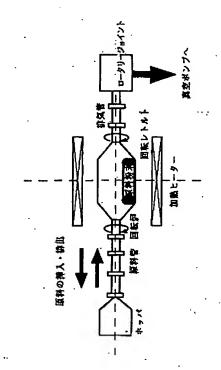
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 異方性磁石粉末の製造方法、異方性磁石粉末の原料粉末およびポンド磁石

(57)【要約】

【課題】永久減磁率に優れるボンド磁石を得ることができる、異方性磁石粉末の製造方法等を提供する。

【解決手段】RFeB系材料(R:希土類元素)に低温水素化工程、高温水素化工程および第1排気工程を施してその水素化物であるRFeBHx粉末を製造し、この出発原料となるRFeBHx粉末(異方性磁石粉末の原料粉末)にジスプロシウム水素化物等からなる拡散粉末を混合し、さらに、拡散熱処理工程、脱水素工程を施すと、保磁力と異方化率に優れる異方性磁石粉末が得られる。そして、この異方性磁石粉末からなるボンド磁石は、永久減磁率に優れる。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】イットリウム(Y)を含む希土類元素(以下、「R」と称する。)とホウ素(B)と鉄(Fe)とを主成分とするRFeB系材料の水素化物(RFeBHr)粉末と、ジスプロシウム(Dy)とテルビウム(Tb)とネオジム(Nd)とプラセオジム(Pr)とよりなる元素群中の1種以上の元素(以下、「R1元素」と称する。)の単体、合金、化合物またはそれら(単体、合金、化合物)の水素化物からなる拡散粉末とを混合する混合工程と、

該混合工程後に該R1元素を該RFeBHx粉末の表面 および内部に均一に拡散させる拡散熱処理工程と、 該拡散熱処理工程後の混合粉末から水素を除去する脱水 素工程(第2排気工程)と、

からなることを特徴とする異方性磁石粉末の製造方法。 【請求項2】前記R1元素の合金、化合物またはそれら (合金、化合物)の水素化物は、3d 遷移元素と4d 遷 移元素とからなる元素群中の1種以上の元素(以下、 「TM元素」と称する。)を含み、

前記拡散熱処理行程は、該R1元素と共に該TM元素を 20 該RFeBH、粉末の表面および内部に均一に拡散させるものである請求項1記載の異方性磁石粉末の製造方

【請求項3】前記RFeBH、粉末は、前記RFeB系材料を600℃以下の水素ガス雰囲気中に保持する低温水素化工程と、該低温水素化工程後のRFeB系材料を水素圧力が0.1~0.6.MPaで750~850℃の水素ガス雰囲気中に保持する高温水素化工程と、該高温水素化工程後のRFeB系材料を水素圧力が0.1~6.0kPaで750~850℃の水素ガス雰囲気中に30保持する第1排気工程と、により製造されるものである請求項1記載の異方性磁石粉末の製造方法。

【請求項4】前記拡散粉末は、ジスプロシウム水素化物 粉末、ジスプロシウムコバルト粉末、ネオジム水素化物 粉末またはネオジムコバルト粉末のいずれかである請求 項1または2記載の異方性磁石粉末の製造方法。

【請求項5】前記混合工程は、混合粉末全体を100m o1%としたときに前記拡散粉末を0.1~3.0mo 1%混合する工程である請求項1記載の異方性磁石粉末 の製造方法。

【請求項6】前記拡散熱処理工程は、400~900℃の酸化防止雰囲気で行う工程である請求項1または2記載の異方性磁石粉末の製造方法。

【請求項7】前記脱水素工程(第2排気工程)は、750~850℃で1Pa以下の真空雰囲気で行う工程である請求項1記載の異方性磁石粉末の製造方法。

【請求項8】前記RFeB系材料は、鉄を主成分とし、 該RFeB系材料全体を100原子%としたときに、1 1~15原子%のRと、5.5~8原子%のBとを含む 請求項1記載の異方性磁石粉末の製造方法。 【請求項9】前記Rは、ネオジム(Nd)である請求項8記載の異方性磁石粉末の製造方法。

【請求項10】前記RFeB系材料は、さらに、ガリウム(Ga)とニオブ(Nb)とのいずれか一方または両方を含む請求項1記載の異方性磁石粉末の製造方法。

【請求項11】イットリウム (Y) を含む希土類元素 (R) とホウ素 (B) と鉄 (Fe) とを主成分とする R Fe B系材料の水素化物 (R Fe B H₂) 粉末からな り、該 R Fe B H₂粉末の平均結晶粒径が 0.1~1.0μmであることを特徴とする異方性磁石粉末の原料粉末。

【請求項12】 イットリウム (Y) を含む希土類元素 (R) とホウ素 (B) と鉄 (Fe) とを主成分とし残留 磁束密度 (Br) と飽和磁束密度 (Bs) との比で表される異方化率 (Br/Bs) が 0.75以上であると共に平均結晶粒径が $0.1\sim1.0$ μ mである異方性磁石 粉末から成形され、

永久減磁率が15%以下であることを特徴とするボンド 磁石。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、異方性磁石粉末の 製造方法、異方性磁石粉末の原料粉末とその製造方法並 びにボンド磁石に関するものである。

[0002]

【従来の技術】磁石は、各種モータ等、我々の周囲にある多くの機器で使用されているが、最近の軽薄短小化や機器の高効率化等により、より強力な永久磁石が求められている。このような永久磁石として、Nd₂FenB等を主成分とする希土類磁石(RFeB系磁石)が注目されており、その用途範囲は益々、拡大傾向にある。例えば、自動車のエンジンルーム内に配設される各種機器のモータ用磁石として、使用が検討されている。ただ、エンジンルーム内は100℃を超える高温にもなるため、そのような磁石には、優れた耐熱性が望まれる。

【0003】ところが、その原料となる異方性磁石粉末 (RFeB系磁石粉末)は温度依存性(温度係数)が大きいため、耐熱性に劣り、特に、高温域における保磁力の低下が大きい。しかも、その温度依存性を改善することも、現状、困難である。そこで、予め大きな保磁力(iHC)をもつ異方性磁石粉末を用いて磁石を製造し、高温域でも十分な保磁力を確保することが考えられる。そして、そのような異方性磁石粉末およびその製造方法が、特開平9-165601号公報や特開2000-96102号公報等に開示されている。

【0004】①具体的には、特開平9-165601号公報に、RFeB系合金溶製中に微量のDyを添加したインゴットを製作し、HDDR (水素処理法: hydrogenation-decomposition-desorption-recombination) 法

徴とする。

により、平均結晶粒径0.05~1μmの異方性磁石粉 末を得る製造方法が開示されている。しかし、本発明者 がこの異方性磁石粉末を実際に作製してみると、微量の Dyの添加しか許されないため、安定した保磁力が得ら れず、量産化も困難であった。また、この製造方法で得 られる異方性磁石粉末の保磁力も、高々16kOe (1 272kA/m)程度である。一般に、異方性磁石粉末 は、保磁力 i HCと、残留磁束密度 (Br) と飽和磁束 密度(Bs)との比で表される異方化率(Br/Bs) との両方が大きい程好ましい。しかし、Dy等の添加は 10 保磁力の向上に有効なものの、HDDR反応を鈍化させ るため、異方化率の低下を招く。このため、それらの両

立を図ることは、従来、困難であった。

【0005】②一方、特開2000-96102号公報 には、既に製造された異方性磁石粉末に、Dy等の合金 粉末を混合し、その混合粉末を真空または不活性がス雰 囲気中で熱処理して、その異方性磁石粉末の表面にDy を薄くコーティングする異方性磁石粉末の製造方法が開 示されている。この方法によれば、適量のDyが粉末表 面にコーティングされるため、保磁力が18kOe (1 20 432kA/m)程度に向上し、異方化率にも優れた異 方性磁石粉末が得られる。しかし、この製造方法では、 Nd₂Fe₁₄B等からなる異方性磁石粉末を出発原料と しているため、Dyをコーティングする際に酸化をコン トロールすることが難しく、コーティング後の異方性磁 石粉末の性能、品質にバラツキを生じる。その結果、そ の異方性磁石粉末から成形した磁石は、後述の永久減磁 率にもバラツキを生じ、安定した耐熱性をもつ永久磁石 が得られなかった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 事情に鑑みてなされたものである。つまり、保磁力およ び永久減磁率に優れた磁石を生産性良く、安定した品質 で得られる異方性磁石粉末の製造方法を提供することを 目的とする。また、その異方性磁石粉末の製造に好適 な、異方性磁石粉末の原料粉末とその製造方法を提供す ることを目的とする。さらに、永久減磁率に優れたボン ド磁石を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】(1)本発明者は、この 40 課題を解決すべく鋭意研究し、試行錯誤を繰返すと共に 各種系統的実験を重ねた結果、RFeB系材料の水素化 物粉末とDy等のR1元素を含む拡散粉末とを混合後 に、拡散熱処理を行うことで、酸化を抑制しつつ、Dy 等が表面および内部に均一に拡散した異方性磁石粉末が 得られることを発見し、本発明の異方性磁石粉末の製造 方法を開発するに至ったものである。

【0008】すなわち、本発明の異方性磁石粉末の製造 方法は、イットリウム (Y) を含む希土類元素 (以下、

「R」と称する。)とホウ素 (B)と鉄 (Fe)とを主 50

成分とするRFeB系材料の水素化物 (RFeBH,) 粉末と、ジスプロシウム (Dy) とテルビウム (Tb) とネオジム (Nd) とプラセオジム (Pr) とよりなる 元素群中の1種以上の元素(以下、「R1元素」と称す る。) の単体、合金、化合物またはそれら(単体、合 金、化合物)の水素化物からなる拡散粉末とを混合する 混合工程と、該混合工程後に該R1元素を該RFeBH x粉末の表面および内部に均一に拡散させる拡散熱処理 工程と、該拡散熱処理工程後の混合粉末から水素を除去 する脱水素工程(第2排気工程)と、からなることを特

【0009】混合工程でRFeBHx粉末と拡散粉末と が混合される際、RFeBH、粉末は、水素を含有して いるため、従来のRFeB系粉末等と較べて、Rまたは Feが非常に酸化され難い状態にある。このため、次の 拡散熱処理工程において、酸化が十分に抑制された状態 で、Dy、Tb、Nd、Pr (R1元素) がRFeBH x粉末の表面および内部に拡散していく。なお、R1元 素のRFeBH、粉末内部への拡散は、結晶粒界への拡 散(粒界拡散)と結晶粒内への拡散とにより、素早く進 行し、R1元素が均一に添加される。

【0010】また、原料粉末であるRFeBHx粉末が 酸化され難いため、酸化を防止しつつR1元素の拡散を 行え、保磁力の大きな異方性磁石粉末が安定した品質で 得られる。そして、この製造方法により得られた異方性 磁石粉末を用いてボンド磁石を成形すると、例えば、永 久減磁率の大きなボンド磁石を得ることができる。ここ で、永久減磁とは、サンプル (試料) 磁石を最初に着磁 したときの初期磁束と、そのサンプル磁石を120℃の 大気雰囲気中で1000時間放置した後に再着磁したと きの磁束との差であり、再着磁しても回復しない磁束を いう。そして、永久減磁率とは、その永久減磁の初期磁 束に対する割合をいう。

【0011】(2)また、本発明者は、このような異方 性磁石粉末を製造する上で好適な、RF e BH 粉末を 開発し、本発明の異方性磁石粉末の原料粉末を為すに至 った。すなわち、本発明の異方性磁石粉末の原料粉末 は、イットリウム (Y) を含む希土類元素 (R) とホウ 素(B)と鉄(Fe)とを主成分とするRFeB系材料 の水素化物 (RFeBHx) 粉末からなり、該RFeB H₄粉末の平均結晶粒径が 0.1~1.0μmであるこ とを特徴とする。

【0012】このRFeBHx粉末からなる原料粉末を 用いることにより、例えば、前述の異方性磁石粉末を容 易に製造することができる。ここで、平均結晶粒径を 0. 1~1. 0 μ m としたのは、平均結晶粒径が 0. 1 μm未満のRFeBHi粉末を製造することは容易では ないからである。また、平均結晶粒径が1.0μmを超 えるRFeBHx粉末では、得られる異方性磁石粉末の 保磁力が低下してしまうからである。

【0013】なお、平均結晶粒径とは、TEM(電子顕微鏡)を用いて観測し、RFeBHI粉末を構成する結晶粒について、2次元画像処理を行い、各結晶粒と等しい面積をもつ等価円を想定し、その平均径を求めたものである。また、前述の異方性磁石粉末およびこの異方性磁石粉末の原料粉末は、その粒形状や粒径が特に限定されるものではなく、微粉末でも粗粉末でも良い。また、RFeB系材料が粉末状であれば、別途、粉砕等を行う粉末化工程を設ける必要はないが、粉末化工程を追加すると、粒径等の均一な異方性磁石粉末やその原料粉末を10得ることができる。

【0014】(3) さらに、本発明者は、例えば、前述の異方性磁石粉末を用いて、永久減磁率に優れる本発明のボンド磁石を開発した。すなわち、本発明のボンド磁石は、イットリウム(Y)を含む希土類元素(R)とホウ素(B)と鉄(Fe)とを主成分とし残留磁束密度(Br)と飽和磁束密度(Bs)との比で表される異方化率(Br/Bs)が0.75以上であると共に平均結晶粒径が0.1~1.0μmである異方性磁石粉末から成形され、永久減磁率が15%以下であることを特徴と20する。

【0015】このボンド磁石は、結晶粒径が微細で異方 化率に優れる異方性磁石粉末からなるため、磁気特性に 優れると共に、永久減磁率が15%以下と低いため、耐 熱性にも優れる。

【0016】なお、永久減磁率が15%を超えるボンド磁石は、耐熱性が劣り、高温環境下での長期使用に適さない。また、異方化率はBrとBsとの比で表されるが、Bsは異方性磁石粉末の組成割合(体積%)により決るものである。例えば、異方性磁石粉末がNd2Felのみからなる場合、Bs=1.6Tとすることが妥当であるのに対し、Dy等が添加されると、Bsがフェリー磁性のため低下することから、Bs=1.4Tと仮定した。

【0017】(4)なお、本発明者は、このRFeBH、粉末を製造する上で好適な、本発明の異方性磁石粉末の原料粉末の製造方法も開発するに至った。すなわち、本発明の異方性磁石粉末の原料粉末の製造方法は、イットリウム(Y)を含む希土類元素(R)とホウ素(B)と鉄(Fe)とを主成分とするRFeB系材料を600 40℃以下の水素ガス雰囲気中に保持する低温水素化工程と、該低温水素化工程後のRFeB系材料を水素圧力が0.1~0.6MPaで750~850℃の水素ガス雰囲気中に保持する高温水素化工程と、該高温水素化工程後のRFeB系材料を水素圧力が0.1~6.0kPaで750~850℃の水素ガス雰囲気中に保持する第1排気工程と、からなることを特徴とする。

【0018】適切な条件下に制御された低温水素化工 程における水素反応が鈍化するためである。なお、Ga程、高温水素化工程および第1排気工程を経ることによ とNbとを複合添加すると、異方性磁石粉末の保磁力とり、RFeB系材料は組織変態を起こし、結晶粒の均質 50 異方化率との両方の向上を図れ、その最大エネルギー積

微細化が図られると共に高い異方性が付与されたRFeBH.粉末が得られる。

[0019]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る実施形態を 挙げて、本発明を詳細に説明する。

(1) RFeB系材料

RFeB系材料は、Yを含む希土類元素RとBとFeとを主成分とするものである。より具体的には、このRFeB系材料は、R2FelBを主相とするインゴット等である。Rは、Yを含む希土類元素であるが、Rは1種類の元素に限らず、複数種類の希土類元素を組合わせたり、主となる元素の一部を他の元素で置換等したものでも良い。具体的なRとして、Yの他、ランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(TM元素)、ルテチウム(Lu)から1種以上選択すると良い。

【0020】特に、Rは、ネオジム (Nd) であると、 好適である。磁性特性に優れた、Nd₂Fe₁₄B等のN dFeB系材料が得られ、また、材料の供給も安定して いるからである。

【0021】また、RFeB系材料は、鉄を主成分とし、RFeB系材料全体を100原子% (a t%)としたときに、11~15at%のRと、5.5~8at%のBとを含むと、好適である。Rが11at%未満では α Fe相が析出して磁気特性が低下し、15at%を超えるとR₂Fe₁₁B相が減少し磁気特性が低下する。また、Bが5.5at%未満では、軟磁性のR₂Fe₁₁相が析出して磁気特性が低下し、8.0at%を超えるとR₂Fe₁₁B相が減少し磁気特性が低下するからである。

【0022】また、RFeB系材料は、さらに、ガリウム (Ga) とニオブ (Nb) とのいずれか一方を含むと、好適である。さらに、両方を複合添加すると、より一層好適である。Gaは、異方性磁石粉末の保磁力iHCの向上に効果的な元素である。特に、RFeB系材料全体を100at%としたときに、Gaを0.01~2at%含むと好適である。0.01at%未満では十分な保磁力の向上が得られず、2at%を超えると逆に保磁力の減少を招くからである。

【0023】Nbは、残留磁束密度Brの向上に有効な元素である。特に、RFeB系材料全体を100at%としたときに、Nbを0.01~1at%含むと好適である。0.01at%未満では十分な残留磁束密度Brの向上が得られず、1at%を超えると、高温水素化工程における水素反応が鈍化するためである。なお、GaとNbとを複合添加すると、異方性磁石粉末の保磁力と異方化率との両方の向上を図れ、その最大エネルギー積

(BH) maxを増加させることができる。また、RFeB系材料は、Coを含有しても良い。

【0024】Coは、異方性磁石粉末のキュリー点の向上に有効な元素であり、特に、RFeB系材料全体を100at%としたときに、Coを20at%以下含むと好適である。

【0025】その他、RFeB系材料は、Ti、V、Zr、Ni、Cu、Al、Si、Cr、Mn、Zn、Mo、Hf、W、Ta、Sn、Oうち1 種または2 種以上を含有しても良い。これらの元素を含有することにより、異方性磁石粉末から製作される磁石の保磁力、角形性を改善することができる。そして、これらの元素は、合計で3at%以下とすることが好ましい。3at%を超えると、析出相などが現れ、保磁力の低下を招くからである。

【0026】RFeB系材料は、例えば、種々の溶解法 (高周波溶解法、核溶解法等)により溶解、鋳造したインゴットやストリップキャスト法で製作したストリップ を原料として用いることができる。また、RFeB系材料は、インゴットやストリップ等を粉砕した粗粉末また 20 は微粉末であると、HDDR処理が均一に進行して好ま しい。この粉砕には、一般的な水素粉砕や機械粉砕等を 用いることができる。

【0027】(2) RFeBHx粉末

RFeBH、粉末は、上述したRFeB系材料の水素化物(RFeBH、)の粉末である。但し、この水素化物(RFeBH、)は、水素が化学結合している場合に限らず、水素が固溶状態にある場合も含むものである。このRFeBH、粉末は、例えば、前述したように、RFeB系材料に所定の低温水素化工程、高温水素化工程、第1排気工程を施して得ることができる。

【0028】なお、RFeB系材料として粉末を用いても良いし、水素化物(RFeBH₁)の製造途中または製造後に適宜、粉砕または粉末化する粉末化工程を追加しても良い。さらには、粉末化工程を後述の混合工程に含めても良い。以下に、本発明の異方性磁石粉末の原料粉末(RFeBH₁粉末)の製造方法について説明する。

【0029】①低温水素化工程

低温水素化工程は、RFeB系材料を600℃以下の水 40 素ガス雰囲気中に保持して、RFeB系材料に水素を吸蔵させる工程である。この低温水素化工程によりRFeB系材料に水素が吸蔵されることにより、後続の高温水素化工程における順組織変態の反応速度の制御が容易となる。

【0030】水素ガス雰囲気を600℃以下としたのは、600℃を超えると、RFeB系材料が部分的に組織変態を起し、組織が不均一となり、好ましくないからである。また、水素圧力は特に拘らないが、例えば、

しい。また、0.03~0.1MPaとしても良い。水素圧力を0.03MPa以上とすることにより、RFeB系材料への水素吸蔵に要する時間を短縮でき、0.1MPa以内とすることにより、一層経済的に水素吸蔵を行い得る。なお、このときの水素ガス雰囲気は、水素ガスのみならず、例えば、水素ガスと不活性ガスとの混合ガス雰囲気であっても良い。また、このときの水素圧力は、水素ガスの分圧となる。このことは、高温水素化工程や第1排気工程においても同様である。

0 【0031】②高温水素化工程

【0032】ここで、水素圧力を0.1~0.6MPaとしたのは、水素圧力が0.1MPa未満では、反応速度が低く、未変態組織が残存して保磁力の低下を招くからである。一方、水素圧力が0.6MPaを超えると、反応速度が高くなり、異方化率の低下を招くからである。また、このときの水素ガス雰囲気の温度を760~860℃としたのは、760℃未満では、三相分解組織が不均一となって、異方性磁石粉末としたときに保磁力の低下を招くからである。また、860℃を超えると、結晶粒が粗大化して、やはり保磁力の低下を招く。

【0033】③第1排気工程

30

第1排気工程は、高温水素化工程後のRFeB系材料を水素圧力が0.1~6.0kPaで750~850℃の水素ガス雰囲気中に保持する工程である。この第1排気工程により、前述の三相分解中のRH₂相から水素が除去され、Fe₂B相の結晶方位が転写させた多結晶が再結合した水素化物(RFeBH₂)が得られる。

【0034】ここで、水素圧力を0.1~6.0kPaとしたのは、0.1kPa未満では、Brの低下を招き、水素が完全に抜けてしまって酸化防止効果が得られないからである。また、6.0kPaを超えると、上述の逆変態が不十分となり、異方性磁石粉末としたときに高保磁力が得られないからである。また、温度を750~850℃としたのは、結晶粒の粗大化を回避しつつ逆変態反応を適切に進行させるためである。なお、前述の高温水素化工程と第1排気工程とを略同温度で行えば、水素圧力の変更のみで高温水素化工程から第1排気工程に移行できる。

【0035】 ④粉末化工程

である。また、水素圧力は特に拘らないが、例えば、 粉末化工程は、RFeB系材料やRFeB系材料の水素 0.1MPa程度とすると、装置的にも経済的にも好ま 50 化物(RFeBH₁)を粉砕してRFeBH₁粉末を得る



工程である。この粉砕には、乾式若しくは湿式の粉砕装置 (ジョークラッシャ、ディスクミル、ボールミル、振動ミル等) 等を用いることができる。

【0036】このRFeBH、粉末は、平均粒径で50~ 200μ m、であると、好適である。 50μ m未満のRFeBH、粉末を得ることは経済的でなく、また、 200μ mを超えるRFeBH、粉末では、拡散粉末と均一に混合できないからである。なお、平均粒径は、サイズの定ったふるいで分級することにより、求めることができる(後述の拡散粉末も同様である)。

【0037】(3)拡散粉末

拡散粉末は、Dy、Tb、Nd、Pr (R1元素)とよりなる元素群中の1種以上の元素の単体、合金、化合物またはそれら(単体、合金、化合物)の水素化物からなる粉末である。

【0038】そして、このR1元素の合金、化合物またはそれら(合金、化合物)の水素化物が、3d遷移元素と4d遷移元素とからなる元素群中の1種以上の元素(TM元素)を含み、拡散熱処理行程で、R1元素と共にTM元素がRFeBH、粉末の表面および内部に均一に拡散するようにすると、より好適である。これらの拡散粉末を用いると、R1元素やTM元素の拡散により、保磁力の向上や永久減磁率の低下を図ることができる。なお、3d遷移元素は、原子番号21(Sc)~原子番号29(Cu)であり、4d遷移元素は、原子番号39(Y)~原子番号47(Ag)であるが、特に、8族のFe、Co、Niが磁気特性の向上を図る上で有効である。

【0039】また、拡散粉末は、R1元素の単体、合金、化合物、またはそれら(R1元素の単体、合金、化 30合物)の水素化物からなる粉末と、TM元素の単体、合金または化合物、またはそれら(TM元素の単体、合金、化合物)の水素化物からなる粉末とを別々に用意しておき、これらを混合、添加したものでも良い。なお、上述の化合物は、全て、金属間化合物も含む。なお、ここでいう水素化物も、水素を固溶状態で含んでいても良い。

【0040】また、拡散粉末が、ジスプロシウム水素化物粉末、ジスプロシウムコバルト粉末、ネオジム水素化物粉末またはネオジムコバルト粉末のいずれかであると、好適である。特に、R1元素としてDyやNdを用いると、異方性磁石粉末としたときの保磁力が向上し、また、TM元素としてCoを含むと、異方性磁石粉末のキュリー点の向上を図ることができる。

【0041】また、拡散粉末は、平均粒径が $0.1\sim5$ 00 μ mであると、好適である。 0.1μ m未満の拡散粉末を得ることは困難である一方、 500μ mを超える拡散粉末では、前述のRFeBHx粉末と均一に混合させることが困難だからである。特に、 $1\sim50\mu$ mであると、RFeBHx粉末と均一に混合でき、好ましい。

【0042】また、拡散粉末は、R1元素(およびTM元素)の単体、合金または化合物を一般的な水素粉砕や乾式若しくは湿式の機械粉砕(ジョークラッシャ、ディスクミル、ボールミル、振動ミル、ジェットミル等)等により、得ることができる。もっとも、水素粉砕を用いると効率的である。このため、前述の拡散粉末が水素化物からなる粉末であると、特に好ましい。R1元素の単体、合金、化合物を水素粉砕する際に、自動的に水素化物が得られるからである。

10 【0043】(4)混合工程

混合工程は、RFeBH_I粉末と拡散粉末とを混合する 工程である。このときの混合には、ヘンシェルミキサ、 ロキシングミキサ、ボールミル等を用いることができ る。

【0044】異方性磁石原材料と拡散粉末とを均一に混合するために、粉砕、分級等を適宜行うと良い。また、分級を行うことにより、ボンド磁石等の成形が容易となる。この混合工程は、酸化防止雰囲気(例えば、不活性ガス雰囲気や真空雰囲気)で行われると、異方性磁石粉末の酸化が一層抑制されて、好ましい。

【0045】また、この混合工程は、混合粉末全体を100mol%としたときに拡散粉末を0.1~3.0mol%混合する工程であると、好適である。両者の混合割合を適切に調整することにより、高保磁力であると共に高異方化率が図られ、永久減磁率に優れた異方性磁石粉末が得られる。

【0046】(5)拡散熱処理工程

拡散熱処理工程は、混合工程後にR1元素やTM元素をRFeBH、粉末の表面および内部に均一に拡散させる熱処理工程である。また、そのR1元素が酸素ゲッタとして機能し、異方性磁石粉末若しくはそれからなる磁石の酸化を抑制する。このため、高温環境下で磁石が使用される場合でも、酸化による磁石の性能劣化を有効に抑制、防止できる。

【0047】この拡散熱処理工程は、400~900℃の酸化防止雰囲気(例えば、真空雰囲気中)で行うと、好適である。400~900℃としたのは、400℃未満では、R1元素やTM元素の拡散速度が遅く、900℃を超えると、結晶粒の粗大化を招くからである。

【0048】(6)脱水素工程(第2排気工程) 脱水素工程は、拡散熱処理工程後の混合粉末から水素を 除去する工程である。この脱水素工程は、750~85 0℃で1Pa以下の真空雰囲気で行う工程であると、好 適である。

【0049】750~850℃としたのは、750℃未満では、残留水素の除去される速度が低く、850℃を超えると、結晶粒の粗大化を招くからである。なお、前述の拡散熱処理工程と脱水素工程とを略同温度で行えば、拡散熱処理工程から脱水素工程に、容易に移行できる。また、1Pa以下としたのは、1Paを超えると、

水素が残留し、異方性磁石粉末にしたときに、その保磁 力が低下するからである。なお、この脱水素工程後に急 冷すれば、結晶粒の成長が防止され、好ましい。

【0050】(7)その他

前述の異方性磁石粉末を用いて、焼結磁石やボンド磁石 を得ることができる。特に、ボンド磁石は、異方性磁石 粉末に、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、カップリング 剤、滑剤等を添加混錬した後、圧縮成形、押出し成形、 射出成形等して製造できる。

[0051]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明について具体 的に説明する。本発明に係る実施例 (試料No. 1-1 ~5-3) である異方性磁石粉末の原料粉末、異方性磁 石粉末およびボンド磁石を、次のように製作した。

【0052】 (実施例1) (試料No. 1-1~1-

(1) 異方性磁石粉末の原料粉末の製造

①RFeB系材料(供試材A)

表1に示す組成Aとなるように、原料合金や原料元素を 秤量し、高周波溶解炉を用いて溶解して、100kgの 20 インゴットを製作した。なお、表1は、全体を100a t%としたときの各元素の含有量をa t%で示したもの である。この合金インゴットに、Arガス雰囲気中で1 140℃×40時間の熱処理を施し、合金インゴットの 組織を均質化した。さらに、この均質化処理後の合金イ ンゴットをジョークラッシャを用いて、平均粒径10m m以下に粗粉砕して、RFeB系材料である供試材とし た。

【0053】②低温水素化工程

この粗粉砕したRFeB系材料 (粗粉砕物) を10kg 30 とり、図1に示す水素処理炉の低温水素処理室に投入 し、密閉した。そして、室温×0.1MPa×1時間の 低温水素化条件 (この条件は、全ての低温水素化工程に 共通)の下で保持した。なお、水素を導入する前に、低 温水素処理室内を真空引きした。

【0054】③高温水素化工程

低温水素化工程に続いて、水素を吸蔵させた粗粉末を大 気に曝すことなく、低温水素処理室から高温水素処理室 に移し、表2に示す高温水素化条件の下で保持した。な お、この高温水素処理室には、水素ガス供給部と水素排 40 気部 (第1排気系と第2排気系) と加熱ヒーターと熱補 償 (熱バランス) 機構とが設けられており、これらを用 いて水素ガス雰囲気を調整することにより、順組織変態 反応の速度を制御した。

【0055】 ④ 第1 排気工程

髙温水素化工程に続いて、髙温水素処理室から第1排気 系を通じて水素等を排気し、表2に示す排気条件下で保 持した。このとき、第1排気系に設けた流量調整バルブ (マスフロメーター) や前述の加熱ヒーター等を用いて

の速度を制御した。その後、冷却室へ移し、原料を冷却 して取出した。こうして、供試材Aの水素化物を製造 し、異方性磁石粉末の原料粉末であるRFeBHz粉末 とした。このとき得られたRFeBHx粉末の粒径は、 使用原料により多少異なるものの、30μm~1mm程 度であった。

12

【0056】(2) 異方性磁石粉末の製造 ①混合工程

得られたRFeBH、粉末に、表2に示す拡散粉末 (平 10 均粒径:5 μm) を添加して、同表に示す条件の下で混 合した。なお、表2に示した拡散粉末の添加割合は、R FeBH₁粉末と拡散粉末とを合わせた全体を100m o 1%としたときのmo 1%である。なお、表2中の 「Dy (Nd) 70Co30」は、拡散粉末全体を10 Oat%としたときに、Dy (Nd) とCoとの含有割 合がそれぞれ70at%と30at%であることを示す (以下、同様)。なお、ここで使用した拡散粉末は、前 述のRFeB系材料と同様の溶製手法を用いて製造した インゴットから得た。

【0057】②拡散熱処理工程

混合工程後、10⁻²P a 以下の真空雰囲気中で、表2に 示す熱処理条件下で拡散熱処理を行った。

【0058】③脱水素工程(第2排気工程)

拡散熱処理工程に続いて、さらに真空排気を行い、最終 真空度が10¹Pa程度となる状態で、表2に示す脱水 素工程を行い、(Dy)Nd2Fe4BH4内に残存する 水素を十分に除去した。さらに、この脱水素工程後に得 られた供試材を冷却室で急冷して、異方性磁石粉末を得

【0059】 (実施例2) (試料No. 2-1) 実施例1と同組成(組成A)であるストリップを、スト リップキャスト法により鋳造して製造し、これを供試材 とした。この供試材に実施例1と同様の工程を、表2に 示す条件下で施し、異方性磁石粉末を製造した。

【0060】 (実施例3) (試料No. 3-1~3-3)

表1に示す組成BからなるRFeB系材料を供試材とし て用い、その他は実施例1と同様にして、表2に示す条 件に基づいて、異方性磁石粉末を製造した。

【0061】 (実施例4) (試料No. 4-1~4-3)

表1に示す組成CのRFeB系材料を供試材として用 い、その他は実施例1と同様に、表2に示す条件下で異 方性磁石粉末を製造した。組成Cは、Coを含むため、 例えば、試料No. 4-1をVSM (Vibratin g SampleMagnetometer) で測定し たところ、そのキュリー点は350℃まで上昇した。次 に、本発明に係る実施例と比較するために、実施例1と 同様に、以下に示す比較例1~5に係る供試材を製作し 水素ガス雰囲気を調整することにより、逆組織変態反応 50 た。但し、実施例1とそれぞれの比較例とは、処理条件

等が部分的に異なる。

【0062】 (比較例1) (試料No. C-1) 実施例1と異なり、拡散粉末を添加、混合せずにRFe B系材料である供試材に表3に示す条件の下で、低温水 素化工程、高温水素化工程、第1排気工程、脱水素工程 を順次行って、異方性磁石粉末を製造した。

【0063】 (比較例2) (試料No. C-2) 実施例1と異なり、拡散粉末の添加割合を3mol%を 超える4mol%とした。その他は、実施例1と同様で ある。

【0064】(比較例3)(試料No. C-3) 実施例1に対して、拡散熱処理工程と脱水素工程との雰 囲気温度をそれぞれ350℃と700℃とに低く設定したものである。

【0065】(比較例4)(試料No. C-4) 実施例1に対して、拡散熱処理工程と脱水素工程との雰 囲気温度をそれぞれ950℃と900℃とに高く設定し たものである。

【0066】(比較例5)(試料No.C-5) 実施例1に対して、出発原料を変更して異方性磁石粉末 20 を製造した。つまり、実施例1と同様の組成をもつRF eB系材料に、表3に示す条件の下で、低温水素化工程、高温水素化工程、第1排気工程、脱水素工程を順次 行って得た粉末を出発原料(粉末)とした。すなわち、 微細結晶粒をもつ水素化物からなる粉末ではなく、水素 を含有していない微細結晶粒をもつ粉末を出発原料とした場合である。その後、この原料粉末に、表3に示す条件の下で、実施例1(試料No.1-1)と同様の拡散 粉末を添加して混合工程および拡散熱処理工程を行い、 異方性磁石粉末を製造した。 30

【0067】(比較例6)(試料No. C-6) 実施例と異なり、最初からDyをRFeB系材料に添加 して表1中の組成Dとなるインゴットを製作し、そのイ ンゴットから得た粉末を原料粉末としたものである。こ の原料粉末に、表3に示す条件の、髙温水素化工程、第 1排気工程、脱水素工程(第2排気工程)を順次行っ て、異方性磁石粉末を製造した。

【0068】(比較例7)(試料No. C-7) 比較例6の組成Dを、表1に示す組成Eに変更して、比 較例6と同様に異方性磁石粉末を製造した。

【0069】(ボンド磁石)上述の実施例および比較例により得た異方性磁石粉末を用いて、それぞれボンド磁石を製造した。つまり、各異方性磁石粉末を磁場中(1200kA/m)で温間成形して7mm角の成形体を製造し、約3600kA/m(45kOe)の磁場中で着磁して、ボンド磁石とした。なお、異方性磁石粉末には、3質量%に相当するエポキシ固形樹脂を添加混錬した。

【0070】 (評価)

(1) 測定

【0071】②また、各異方性磁石粉末から製造したボンド磁石について、永久減磁率を求めた。この永久減磁率は、先ず、約3600kA/mで着磁したときの(初期)磁束(残留磁束密度)を測定しておき、次いで高温槽で120℃×1000時間保持した後に再着磁し、その後の磁束を再度測定して、それら両磁束から求めた。【0072】③さらに、実施例1の試料No.1-1(表2)の異方性磁石粉末について、EPMA(Electron Probe Microanalyser)観察を行った結果を図3に示す。図3は、その粉末(測定粒度:75/106 μ m)のDyについて分析した、EPMAの結果を示したものである。なお、この観察は、粉末を樹脂に埋込み、鏡面研磨した後に観察したものである。

【0073】(2)結果

②表4から、本発明の実施例に係るいずれの異方性磁石 粉末も、十分な保磁力 i H C と共に異方化率 (または残 留磁束密度 B r)をもつ。また、その異方性磁石粉末か らなるボンド磁石も十分低い永久減磁率をもっているこ とが解った。

【0074】②一方、比較例1では、拡散粉末が添加されていないために、異方性磁石粉末は十分な保磁力iHCをもたず、また、そのボンド磁石の永久減磁率も大きなものであった。また、比較例2では、異方性磁石粉末の保磁力とそのボンド磁石の永久減磁率は共に良好であるが、拡散粉末の添加量が多いため、異方化率が低下してしまい、保磁力と異方化率との両立を図れなかった。また、比較例3および比較例4では、拡散熱処理工程および脱水素工程の処理温度が好ましくないため、著しく保磁力が低く、ボンド磁石としたときの永久減磁率も高いものであった。なお、比較例4では、異方性磁石粉末自体の保磁力が著しく低いため、ボンド磁石は製作するまでもなかった。

【0075】また、比較例5では、脱水素工程まで終了した粉末を出発原料としたために、拡散粉末の混合、拡散に際して、酸化を十分に抑制することはできなかった。このため、同じロットの異方性磁石粉末であっても、上部に位置する異方性磁石粉末と下部に位置する異方性磁石粉末とは、磁気特性が大きく変化した。表4では、上部位置の異方性磁石粉末と下部位置の異方性磁石粉末に関する磁気特性をそれぞれ示した。また、下部に50位置する異方性磁石粉末には、磁化曲線上にクニックが

20

現れ、部分的に酸化していることが解った。すなわち、 異方性磁石粉末の表面に吸着された酸素ガスが、その粉 末と反応して希土類元素を酸化させたことにより、保磁 力 i H c が低下したと考えられる。この結果、脱水素工 程後に拡散粉末を添加して、混合工程、拡散熱処理工程 を行っても、酸化を防止できず、しかも、安定した品質 の異方性磁石粉末を得ることができないことが解った。

【0076】また、比較例6では、当初からDyをRF e B系材料に含めて、表3に示す適切なHDDR処理を行ったため、保磁力自体は満足できるものであったが、 引 得られた磁石粉末が等方化してしまい、BrおよびBH maxも著しく低下してしまった。また、比較例7では、比較例6に比べDyの添加量が少ないため、BrおよびBHmaxは満足できるものであったが、保磁力が不十分で、永久減磁率は著しく劣ったものとなった。

【0077】 ③ 図3に示したEPMA写真から、R1元素であるDyが異方性磁石粉末の表面および内部に均一に拡散していることが解る。次に、図2に示する装置を用いて異方性磁石粉末を製造した場合を、実施例5として以下に説明する。

【0078】 (実施例5) (試料No. 5-1) 実施例2のストリップからなる供試材を用いて、実施例 1と同様の工程を表2に示す条件下で行い、異方性磁石* *粉末の原料粉末 (RFeBH:粉末) を製造した。そして、このRFeBH:粉末を、図2に示す装置 (回転レトルト炉装置) のホッパにそのまま回収して、表2に示す条件の下で、順次、混合工程、拡散熱処理工程、脱水素工程を行った。

【0079】この回転レトルト炉装置は、図2に示すよ うに、原料粉末を投入または回収するホッパと、このホ ッパに一端が接続されてモータ (図示せず) により回転 する回転レトルトと、この回転レトルトの他端で回転レ トルトを支持すると共に真空ポンプに接続されたロータ リジョイントと、回転レトルトを加熱する加熱ヒータと からなる。回転レトルトは、中央に原料粉末を収納でき る回転炉を備え、その一端とホッパとの間を接続する原 料管と、回転炉の他端とロータリジョイントとを接続す る排気管とからなる。それらは、一体的に回転し、原料 粉末は原料管を通じて挿入・排出され、また、回転炉の 排気は排気管を通じて真空ポンプにより行われる。そし て、図示していないが、回転レトルトの駆動モータ、加 熱ヒータ、真空ポンプ等は、パソコン等からなる制御装 置によって制御され、設定条件下で各工程が行えるよう になっている。

[0080]

【表1】

RFeB系材料			組成	(at %).	•			推考
	Nd Ga Nb B		Co	Dy	Fe			
A	12,5	0.3	0.2	6.4	_:		残部	実施例1 (インゴット) 実施例2、6(ストリップ) 比较例1~5(インゴット)
В	125	0,5	0,1	6.4	-	÷	残部	実施例3 (インゴット)
С	125	0.3	0.2	6.4	5.0	_	残部	実施例4・(インゴット)
D	11.5	0.3	0.2	6.4	_	1.0	残部	比較例6 (インゴット)
E	12.1	0.3	0.2	6.4	_	0.4	残部	比較例7 (インゴット)

[0081]

【表2】

1-1 DM12 S20 G.03 S S20 G.93					摊	高温水素化条件	生	秧	第1排気条件	址	77	混合条件		描	拡散熱処理条件	#	※無	脱水素条件 (第2排気条件)	. 🚓
1-1 DM-2 S20 O. O.3 S S20 1 Z40 M33 A-M-7 1 S00 -10 ⁻⁴ O. S S00 -10 ⁻⁴ 1-2 DM-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			¥.	有新数米	製	田	E	Ħ	压力	E	**	田力	E	Ħ	東京庫	臣	H		=
1-1 DMP2 R20 O.03 R R20 T R40 R41 R50 C-10 ⁻⁴ O.5 R50 R50 C-10 ⁻⁴ O.5 R50 R5				(mol%)	9	(MPe)		3	(kPe)	€	ĝ	(MPa)	. (MM)	3	(Pa)	(時間)	(C C)	(Pa)	
1-2 DM2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1-1	DyH2 1.0	820	0.03	œ	820	-	240	照	Arガス 0.1	-1	800	~10_4	o	800	~10_4	Ö
1-3 MATOC-50 1		_	1-2	DyH2 0.1	1	+	1	+	+	-	1	-	+	+	ļ	•	1	-	.
1-4 Dyffice and 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1–3	Nd70Ce30 1. 0	+-	-	-	-	+	-	+	-	+	4	1	1	ļ	1	+
2 2-1 DyH2 B25 0.03 T B25 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			1-4	Dy70Co30 1. 0	-		-		-	-	+	-	+	+	-	-	1	1	ļ
3 3-2 Nd42 825 0.03 T 825 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	•	8	2-1	DyH2:	-	-	-		-	-	-	1	-	- .	1	٠	+	-	← ,
3 3-2 NdH2 826 0.03	张 和		3-1	DyH2 1.0	825	0, 03	4-	825	4	+	•	+	•	4	+	1	+	-	-
3-3 by/bcosts 820 0.035 1 820 2 1 200 1 <th>35</th> <td>60</td> <td>3-2</td> <td>NdH2 1.0</td> <td>825</td> <td>ი. თვ</td> <td>+</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>÷</td> <td>–</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>;-</td>	35	60	3-2	NdH2 1.0	825	ი. თვ	+	826	+	-	+	÷	–	+	-	0.5	1	-	;-
4-1 DMH2 1.0 modes 820 0.04 1 820 0.04 1 <th></th> <td></td> <td>8-3</td> <td>Dy70Co30 1. 0</td> <td>820</td> <td>0.035</td> <td></td> <td>820</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>ļ</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>1</td> <td>Į</td> <td>+</td>			8-3	Dy70Co30 1. 0	820	0.035		820	8	-	200	-	1	ļ	-	+	1	Į	+
4-2 NAH2 810 0.045 1 800 3 1 整置 1			4-1	DyH2 1.0	820	0.04	+	820	-	+	-	4	-	Ļ	-	1	. 1	1	-
4-3 MdH ₂ 810 0.045 t 810 1 t 150 t t t t t 0.045 t 0.045 t 830 t 1 t t t t t t t t t t t t t t t t t		4	4-2	N470Co30 1. 0	800	0.04	ţ	800	8	1	調料	+	+	1	+		-	-	-
6-1 DyH2 830 0.035 1 830 1 1 1 1 1 t t 1 t t			43	N4H ₂	810	0.045	-	810	-	1	150	+	-	←	1	-	-		O.
		ω	6-1	DyH2 1.0	830	0.035	1	830	1	1	-	+	-	ļ	+	-	•-	-	

【表3】

[0082]

				麗	高温水素化条件	车	継	第1排気条件	#	.,.	混合条件		類	拡散熱処理条件	£#	華無	脱木素条件 (第2排気条件)	#æ
	-	No.	鉱散粉末	調味	压力	起	題	Εħ	聖世	編	压力	世	観	東空底	脚軸	羅	東空底	蓝位
			(mol%)	(၁)	(MPa)	(阿里)	(C)	(кРа)	(45)	(2)	(MPa)	(時間)	(C)	(Pa)	(時間)	Ŝ	(Pa).	
	-	<u>-</u> 2	1.	820	0.03	8	820	1	240	ı	ı	1	800	~10_4	0. 5	800	~10_~	0. 5
	7	C-2	DyH2 4, 0		←	+	-	-	-	湖	Ar ガス 0. 1	-	-	-	-	+	1	+
	ဗ	C-3	DyH2 1.0	1	1	.	1	←	-	1	+	ļ	350	+	1	004	1	+
式数盘	4	C-4	DyH2 1.0	-	← .		Ţ	+	1	-	←	←-	950		1	006	1	←
\$	Q	C–6	DyH2. 1.0	1	+	1	1	-	+	+	÷	+	800	+	+	800	1	-
	9	C-'B	t	860	0.08	1	098	+	ļ	-	1	1	ı	I	Ι.	800	1	1.0
	٠ ٦	c-7	t	4-	1 0.05	+	ı	÷	ţ	- :	1	1	1	. 1	1	4-	1:	+

低温水素化工程:整温×0.1MPa×1時間

[0083]

【表4】

				與方性?	进石粉末		ポンド独石	
		試料 No.	最大エネル ギー積	残留磁束密度	·保磁力	具方化率	永久滅磁率	備考
		_	(BH)max (kJ/m³)	Br (T)	iHC (kA/m)	Br/Be	(96)	
		1-1	258	1.16	1527	0.83	7	
	1	1-2	309	1.3	1320	0.92	9	
		1-3	288	1.27	. 1114	0.91	12	
		1-4	270	1.23	1416	0.87	9	
夹	2	2—1	282	1.24	1209	0.88	10	
施		3-1	255	1.18	1511	0.84	В	
例	3	3-2	301	1.32	1090	0.82	10	
נפו		3 <u>-</u> 3	272	1.18	1479	0.84	8.2	
		4-1	278	1.22	1488	0.87	7.6	
	4	4-2	307	1.34	1106	0.84	9.2	•
		4-3	271	1.22	1448	0.87	8.1	:
	5	5-1	248	1.15	1511	0.82	10	•
	1	C-1	298	1.32	986	0.82	18	
	2	C-2	159	0.9	1591	0.64	8	
比	3	с-з	199	1.12	398	0.8	20	•
較	4	Ċ−4	95	1.02	103	0.73	_	
91	· 5	C-5	239/207	1.13/1.04	1488/1138	0.81/0.74	11/20	上部位置 /下部位置
	6	C-6	95	0.74	1432	. 0.5	_	
	7	C-7	239	1.15	1273	0.82	18	

[0084]

【発明の効果】本発明の異方性磁石粉末の製造方法、異 30 方性磁石粉末の原料粉末とその製造方法およびボンド磁石によれば、保磁力に優れた異方性磁石粉末が得られ、また、永久減磁率の低いボンド磁石が得られる。

【図面の簡単な説明】

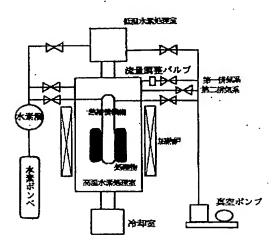
【図1】異方性磁石粉末の原料粉末等の製造に用いた水*

*素処理炉を模式的に示した図である。

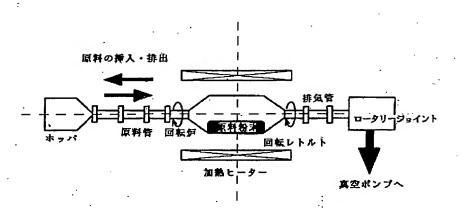
【図2】拡散粉末の混合工程、拡散熱処理工程および脱水素工程を一連の工程として行うことができる回転レトルト炉装置を模式的に示した図である。

【図3】本発明の一実施例である異方性磁石粉末の表面をEPMA観察した写真である。

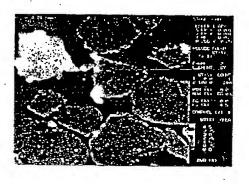
【図1】



【図2】



【図3】



100 µ m

【手続補正書】

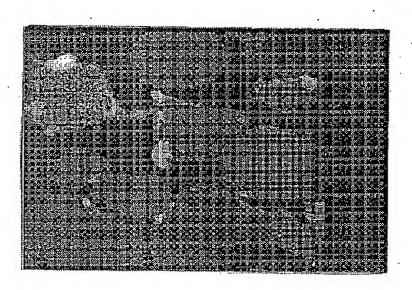
【提出日】平成12年12月19日(2000.12.

19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図3 【補正方法】変更 【補正内容】 【図3】



100 µ m 1

組成: 1. Omol XDy 測定粒度: 75/106 μ m

温度:1073K 時間:3,6ks

脱水素工程

図面代用写真 (カラー)

フロントページの続き

(72)発明者 三嶋 千里

愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地 愛知製

鋼株式会社内

Fターム(参考) 5E040 AA04 AA20 CA01 HB09 HB11

HB17 NN18

5E062 CD04 CE01 CF02 CG01 CG03

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.